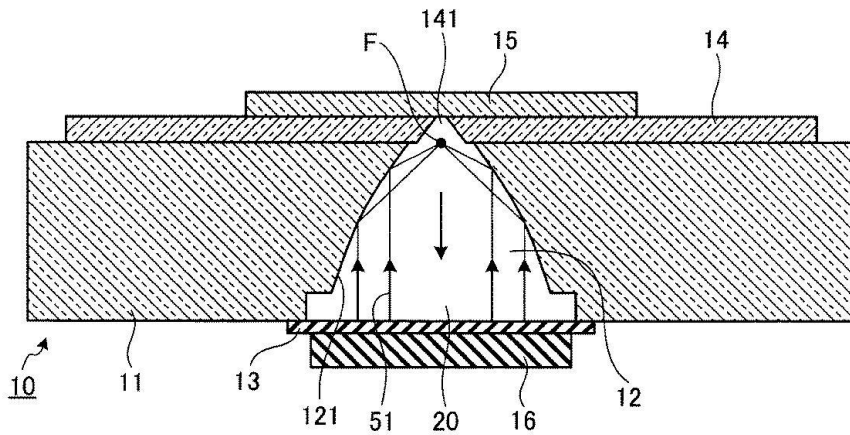


公開番号／特許登録番号	特許5627560
発明の名称	微粒子製造塗布装置および微粒子塗布方法
出願人または特許権者	三菱電機株式会社

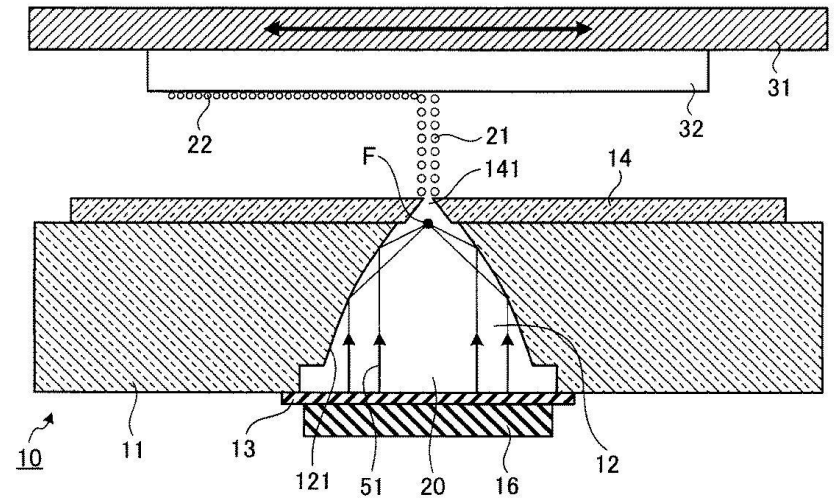
発明の内容 (概要)

【課題】 微粒子を球状に近い形状にするとともに、所望の位置に微粒子を塗布することができる微粒子製造塗布装置を得ること。

【解決手段】 微粒子を含有する微粒子分散液 20 を封入する分散液保持室 12 と、微粒子分散液 20 に超音波 51 を印加する超音波印加手段と、分散液保持室 12 から微粒子分散液 20 を吐出するノズル 14 と、を備え、分散液保持室 12 は、超音波印加手段によって超音波 51 を印加された微粒子分散液 20 が分散液保持室 12 内で複数反射するように反射構造を有する。



微粒子製造塗布装置を示す断面図



微粒子製造塗布装置の塗布処理時の状態の模式図

- | | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------|--------------|
| 10 微粒子製造塗布装置 | 11, 15 反射板 | 12 分散液保持室 | 13 蓋部材 | 14 ノズル |
| 16 圧電素子 | 20 微粒子分散液 | 21 ミスト | 22 Si微粒子 | 23 アモルファスSi層 |
| 31 基板ステージ | 32 基板 | 51 超音波 | 121 壁面 | 141 吐出口 |